

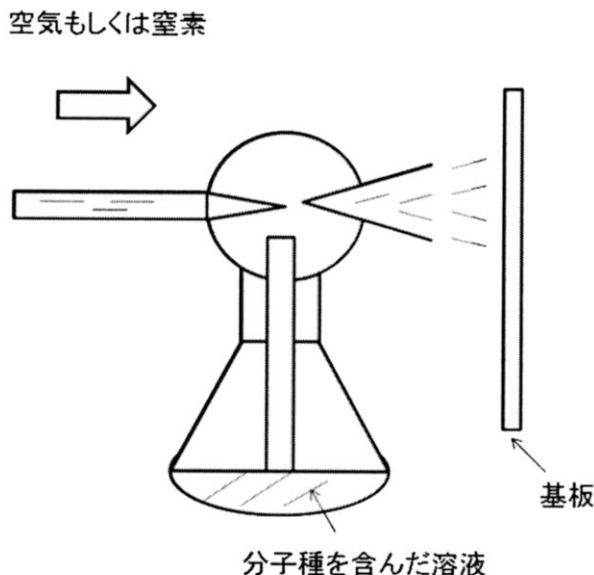
公開番号／特許登録番号	特許5245167
発明の名称	自己組織化膜作製法
出願人または特許権者	国立研究開発法人 産業技術総合研究所

発明の内容 (概要)

【課題】 単分子膜形成時間を大幅に短縮し、大面積基板への適用も可能とする自己組織化膜の作製方法を提供する。

【解決手段】 基材表面に、分子の少なくとも一端にフォスホン酸基又はカルボン酸基を持つ有機化合物の溶液をスプレー法で塗布し、その後、該基板を洗浄、乾燥することにより、大面積基板への自己組織化膜の形成を可能にできる。

噴霧器については溶液を気化できる形状であれば特に形状に定めはない。



また、本発明のスプレー法に用いるガスは、通常は空気ですが、大気中の酸素などとの溶質の反応が問題になる場合には窒素、アルゴンなどの不活性ガスを用いることが望ましい。

本発明に用いた噴霧器と実験の概念図